

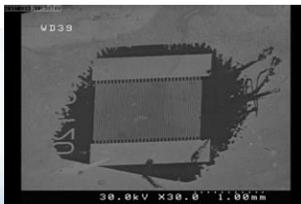
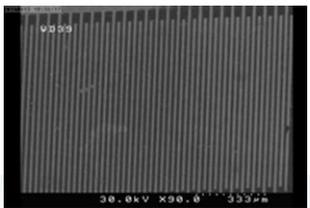
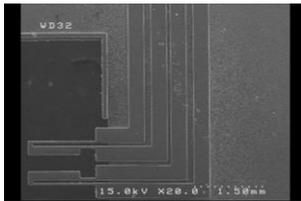
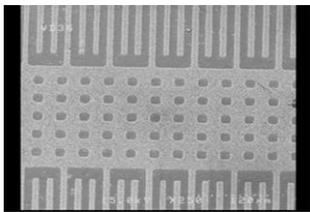
Nano Pajouhan Raga Co.

Litho Mask Reducer Aligner Large Area



لیتوگرافی تنظیم کننده ماسک فرآیندی است که طی آن طرح و الگوی دلخواه را با دقت بالا بر روی سطح مورد نظر ایجاد می کنند. دسترسی به دقتهای بالا، و رود به دنیای میکروسکوپی، سرعت پاسخ دهی بالا، اندازه کوچک قطعات و هزینه پایین از جمله ویژگیهای این روش می باشند.

لیتوگرافی در گستره وسیعی از صنایع کاربرد فراوانی دارد که از آن جمله می توان به ساخت انواع حسگرها نظیر شتاب سنجها، فشار سنجها و نیز انواع محرکها اشاره کرد. یکی از کاربردهای دیگر این دستگاه در ساخت آزمایشگاههای میکرومتری بر روی یک تراشه می باشد که امروزه در دنیا گسترش فراوانی پیدا کرده است.



- ✓ لیتوگرافی با دقت ۱۰ میکرومتر
- ✓ ایجاد الگو تا ابعاد ۱ سانتیمتر مربع
- ✓ قابلیت جابجایی و کنترل ماسک
- ✓ دارای قابلیت کنترل شدت و زمان نوردهی
- ✓ کنترل دقیق فرآیند با استفاده از میکروسکوپ دیجیتال
- ✓ کنترل ادوات اپتیکی بصورت موتورایز با دقت بالا
- ✓ بکاربری سیستم نوین موازی سازی جهت افزایش دقت